



除害装置事業における温室効果ガスの分析・計測サービスを開始

昭和電工株式会社（社長：森川 宏平）は、半導体や液晶パネルなどの製造工程で排出される各種有害ガスを処理する除害装置に関する事業において、除害装置の性能を評価する温室効果ガスの分析・計測サービスを開始します。

半導体や液晶パネルの製造工程では、PFCs^(注1)などさまざまな温室効果ガスが使用されますが、これらのガスの使用者は自らの生産ラインから排出される温室効果ガスを除害処理し、排出量を算定して国に報告することが義務付けられています。

排出量の算定方法は2006年IPCC^(注2)ガイドライン^(注3)にまとめられていますが、ガイドライン制定後の科学的・技術的進展を考慮して一定の改良が必要と考えられ、2019年5月に京都で開催されるIPCC第49回総会にて、現在のガイドラインを更新・追加・精緻化する改良案が採択・承認に向けて検討される予定です。

改良版のガイドラインには、プロセスや除害技術ごとに除害効率値の基準が設定される見込みですが、測定には工数がかかり、分析ノウハウも必要です。当社は、これら温室効果ガスを分解する除害装置を製造販売してきたことにより各種ガス類の取り扱いのノウハウを有することから、2019年5月より従来のメンテナンスに加え、オプションとして除害効率（装置の出口、入口のガス濃度）の分析・計測サービス^(注4)を提供することを決定いたしました。

当社は、本年スタートした中期経営計画“The TOP 2021”において「CUSTOMER Experienceの最大化」を経営戦略に掲げております。電子材料用高純度ガスや除害装置の製造販売およびメンテナンスサービスを提供するだけでなく、除害装置による除害処理性能を評価する測定サービスを加えることで、電子材料用高純度ガス事業に関連する幅広いソリューションを提供し、CUSTOMER Experienceの最大化に努めてまいります。

以上

(注1) PFCs

パーフルオロ化合物の略で、半導体や液晶パネルの製造工程でのエッチングや洗浄に使用される代替フロンガスの一種。代表的なものとして、CF₄、C₂F₆、C₃F₈、C₄F₈、CHF₃、SF₆、NF₃の7種をPFC等ガスという。

(注2) IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC、国連気候変動に関する政府間パネル)

人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うため、1988年に世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)により設立された組織で、政府の推薦で選出された専門家による科学的分析、社会経済への影響、気候変動を抑える対策が盛り込んだガイドラインが示され、国際的な地球温暖化問題への対応策を科学的に裏付ける組織として大きな影響力がある。

(注3) IPCC ガイドライン (正式には「気候変動に関する政府間パネル国別温室効果ガス排出インベントリガイドライン」)
我が国を含む気候変動枠組条約の附属書 I 締約国が、1 年間に排出・吸収する温室効果ガスの量を取りまとめたデータである温室効果ガスインベントリを作成する際に使用する算定基準のこと。

(注4) 除害効率 (ガス濃度) の測定サービス

主に FT-IR (フーリエ変換赤外分光光度計) を使用して、除害装置の出口・入口の温室効果ガスの分析を行い、除害効率を測定する。同時に HF などの温室効果ガスを分解したガスについても測定可能。さらに、GC (ガスクロマトグラフ) も必要に応じて用いることで、FT-IR で分析できないガス (F₂ など) の分析もできる。

◆ 本件に関するお問い合わせ先 広報室 03-5470-3235